

Bitte
frei
machen

Fraunhofer IPK
Claudia Engel
Pascalstr. 8-9
10587 Berlin

ANTWORT

Bitte Rückseite ausgefüllt zurücksenden oder
per Fax an +49 30 39006-392 schicken.

MEHR KÖNNEN

INFORMATIONEN

Veranstaltungsort

AMP – Anwendungszentrum Mikroproduktionstechnik
Pascalstr. 13-14
10587 Berlin

Beitrag

kostenlos

Veranstaltungsleiter

Dr. Dirk Oberschmidt
Fraunhofer IPK
Tel. +49 30 39006-159
dirk.oberschmidt@ipk.fraunhofer.de

Dr. Dietrich Imkamp
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
Tel. +49 7364 20-2045
dietrich.imkamp@zeiss.de

© TITELBILD: CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

© FRAUNHOFER IPK, DEZEMBER 2015

Mehr Können

VERANSTALTUNGEN 2016

Dem wachsenden Bedarf an beruflicher Weiterbildung gerecht zu werden und den Wissenstransfer aus der Forschung in die Industrie noch intensiver zu fördern, das ist das Ziel des Veranstaltungsprogramms »Mehr Können« des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK. Auf unseren Tagungen und Konferenzen, Technologietagen, Industriearbeitskreisen, Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen praktisch anwendbares Wissen über topaktuelle Technologien und Verfahren für das Management, die Produktentstehung, den Produktionsprozess und die Gestaltung moderner Fabrikbetriebe.

Gehen Sie weiter – wissenschaftlich fundiertes, praxisnahes Know-how bringt sie voran.

Unsere Veranstaltungen bieten mehr als theoretische Wissensvermittlung. Hier können Sie Technologien und Methoden selbst ausprobieren und erhalten aus erster Hand Beispiele für ihre erfolgreiche Anwendung. Zudem stellen wir höchste Ansprüche an die Qualität unserer Inhalte und ihrer Vermittlung: Das Fraunhofer IPK ist durch die DQS nach der Norm ISO 9001:2008 zertifiziert. Mehr über unser Angebot erfahren Sie unter www.ipk.fraunhofer.de/weiterbildung

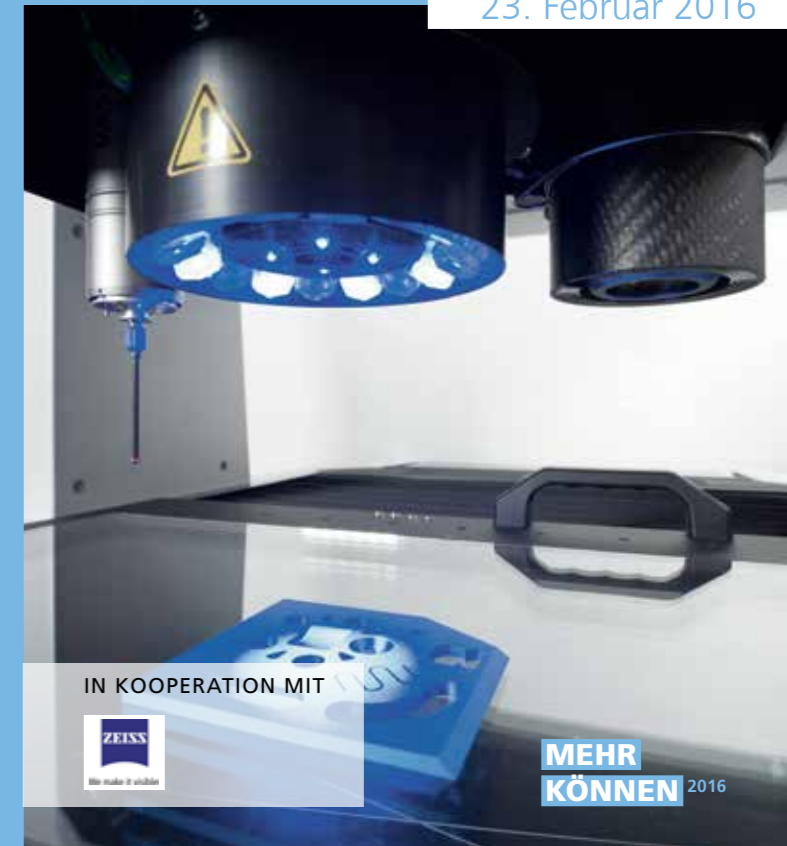
 **Fraunhofer**
IPK

ANWENDERTAG

Produktionstechnisches Zentrum Berlin

Mikroskopie und Messtechnik

23. Februar 2016



IN KOOPERATION MIT



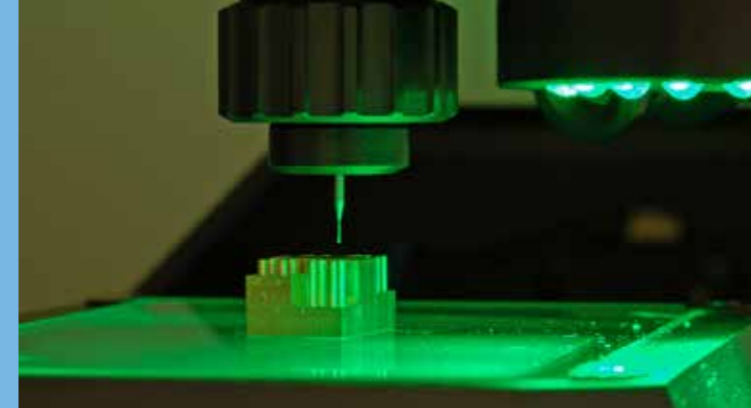
**MEHR
KÖNNEN** 2016

Mikroskopie und Messtechnik

ANWENDERTAG

PROGRAMM

Dienstag, 23. Februar 2016



Die ständig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit, Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Nachhaltigkeit neuer Produkte erfordern zunehmend den Einsatz hochpräziser Fertigungsmesstechnik als Instrument der Qualitätssicherung. Trends wie die Miniaturisierung von Bauteilen oder die Zunahme der Bauteilkomplexität durch Integralbauweise verstärken den Bedarf an innovativen Prüfmethoden. Das Anwendungszentrum Mikroproduktionstechnik AMP am Fraunhofer IPK verfügt über langjährige Erfahrungen in der Anwendung, Entwicklung und Maschinenintegration von Mikromesstechnik und lädt Sie gemeinsam mit Carl Zeiss Industrielle Messtechnik zum Anwendertag »Mikroskopie und Messtechnik« nach Berlin ein.

Wir geben Ihnen einen Überblick über das breite Spektrum der optischen Messtechnik, industriellen Computertomographie und Materialmikroskopie. Expertenvorträge sowie zahlreiche praxisorientierte Vorführungen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich umfassend über neue Technologien und Zukunftsperspektiven zu informieren. Darüber hinaus bieten wir gemeinsam mit ZEISS Live-Messungen an. So können Sie vor Ort mit eigenen Musterteilen die Möglichkeiten und Grenzen einer Technologie gemeinsam mit den Experten von ZEISS und Fraunhofer IPK ausloten. Dabei möchten wir mit Ihnen gerne diese Themen diskutieren und Mittel und Wege aufzeigen, wie diese Messaufgaben und Dokumentationen praktisch umgesetzt werden können.

9.45 Begrüßung durch Fraunhofer IPK und ZEISS Industrial Metrology

10.00 Messtechnik in der Mikroproduktion: Herausforderungen und Anwendungen

Dr. Dirk Oberschmidt, Fraunhofer IPK

10.30 Die Übertragung der Synchrotron-Röntgenmikroskopie auf Labor-Röntgenmikroskopie als korrelative Abbildungstechnik

Dr. Mohsen Samadi Khoshkhoo, ZEISS

11.00 Mikroskopie und Rasterkraftmikroskopie am Beispiel biologisch relevanter Proben

Dr. Anja Spielvogel, Fraunhofer IPK

11.30 Informationsfusion durch korrelative Methoden und Multisensorik

Dr. Dietrich Imkamp, ZEISS

12.00 Mittagspause

13.00 Führung und Live-Messungen an den Produkten ZEISS METROTOM, ZEISS O-INSPECT, ZEISS Smartzoom 5

15.00 Messunsicherheit beim Messen mit industrieller Computertomographie

Nikolas Sawczyn, IWF TU Berlin

15.30 Kaffeepause

15.45 Messunsicherheit und Prüfmittleignung für Koordinatenmessgeräte mit taktilem und Kamera-Sensorik

Ana Mayr, ZEISS

16.15 Rundgang AMP

17.00 Voraussichtliches Ende

Ein Anwendertag für

ExpertInnen und InteressentInnen aus Industrie, Forschung und Wissenschaft

ANMELDUNG

Ja, ich möchte am Anwendertag »Mikroskopie und Messtechnik« am 23. Februar 2016 teilnehmen.

Name *	Vorname *	Titel
Firma / Institut *		
Position		
Abteilung		
Straße / Postfach *		
PLZ / Ort *		
USt-IdNr. (außer Privatpersonen oder Unternehmen ohne USt-IdNr.)		
Buchungsnr. (falls erforderlich)		
Rechnungsadresse, falls abweichend		
Telefon *	Fax	
E-Mail *	* Daten erforderlich	

Datum, Unterschrift

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben.

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten vom Veranstalter elektronisch gespeichert und im Teilnehmerverzeichnis der Veranstaltung abgedruckt werden. Meine personenbezogenen Daten werden darüber hinaus vertraulich behandelt und im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich zur Veranstaltungsorganisation des Fraunhofer IPK sowie zur zukünftigen Information über Veranstaltungen des Instituts genutzt. Ich habe das Recht, meine Einwilligung zur Speicherung und Nutzung meiner Daten jederzeit zu widerrufen und der Zusendung von Informationsmaterial zu widersprechen.

